83 C 0 (83 E 17) (83 E 0)

## 等 等 产 実 用 新 寒 公 報

実用新案出願公告 日召42-20750 公告 昭42.12.2 (全2頁)

エレベーターコープ滑り量の検出装置。

奥 頤 昭 39-1825

出 顧 日 昭 39.1.14

考 案 者 都樂繁彦

日立市助川町1405株式会社日

在製作所自立研究所內

间 四原元久

鬩所

同 田山治男

间所

山 蝦 人 徐式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1の4

代 表 省 朔井健一郎

代 運 人 弁理士 高級明夫

## 図面の簡単な説明

第1図は本案の原理説明図、第2図は本案一実 施例の側面図である。

## 考案の詳細な説明

一般にニレベーターローブとシーブ間にはその 起動又は停止時に慣性により滑りが生じ易く、こ の滑り量は全ローブ長さに比べれば極めて僅かで あるが操作頻度が極めて多いのでエレベーターの 連続操作時にはシーブを摩託せしめる直接の原因 となつている。

この盤かな滑り量を随時配録するために本案はなされたもので、、エレベーターロープおよびシーブの個々の速さを光電的に検出、比較しその相対速度の変化を随時検出するようにしたものである。先ず第1図により本案の原理を説明すれば、ローブ1のピッチPの周期性を利用して投光器2

受光器3により各ピッチ毎にパルスを計数しローブ連度を検出せんとするものである。

本案一実施例を第2図により説明すれば、ロープ1とシーブ4との関係を示し滑り量を検出せんとするものである。即ちシーブ4の回転速度の計数はその録号に明暗模様の額をローブ1のピンチPと等間隔に配列しておき投光器21至光器3により行いローブ1の回転速度も投光器211分光器により行いローブ1の回転速度も投光器211分光器により領定する。従つてローブ1及びシーブ4より発生される光電パルスを整形後アナログ量に変換してその両者を比較記録せしめれば任意時刻の滑り量を時々刻々記録せしめることが可能である。

以上の如く本案においてはエレベーターニーブ 1の滑り量を確実に検出できるものでそのローブ 1の切断あるいは空回り等による事故を未然に防 止することができるという工策上大きな利点をを する。なお、エレベーターローブは多くの素缺を 用い、また油で汚れた状態で使用されるので、は たして曳好なるローブピッチの測定ができるか、 たして曳好なるローブピッチの測定ができるが、 しかし、被照射光位置の寸前でエレベーターローブの最外間の汚れを拭払し、かつ他の部分を光の 反射能力が激減する程度に油(光の吸収が大なる 油)などで被膜状態にすれば、このような心能を たやすく一掃できる。

## 実用新案登録請求の範囲

エレベーターのシーブにローブピッチと等間隔の明暗模様を施しロープとシーブの相対速度の変化を光電的に比較記録せしめることによつてロープの滑り量を検出するようにしたことを特徴とするエレベーターローブ滑り量の検出装置。

ζ.

安公 昭42-20750

